パラメータシート (エレクトロニクス・技術) 様式:6T-1

外為令別表の7の項、省令第19条第1項~第5項

提供技術名	
メーカー名	

メーカー名			
			CISTEC 2021. 12. 15
質問事項	回答		15日施行省令等対応) 備考
	四百	i (左) /	用つ
技術(プログラムを除く。)は→1. 及び2. へ			(注2)
□プログラムは→3. へ			·· - -/
選択した項目の□に✓をマークし、下記の質問に回答のこと。			
[省令第19条第1項及び第3項の技術]			
□ 1. 次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な			
技術(プログラムを除く。)か?			
(1)省令第6条第二号ハ(一)5若しくは6若しくは(二)3	□いいえ	□ は い	「付表技術」(注3)
に該当するモノリシックマイクロ波集積回路増幅器、	1	↓	
同条第二号二(一)5若しくは6若しくは(二)3若しくは4			省令第6条
に該当するマイクロ波用ディスクリートトランジスタ、			第二号ハ(一)5等
又は同条第十六号ロに該当する原子周波数標準器			左記の貨物は
(外7項(1)、省令第19条第1項第一号)			「告示貨物」 (注4)
(2)省令第6条に該当するもの(同条第二号ハ(一)5若しくは6	□いいえ	□はい	
若しくは(二)3若しくは二(一)5若しくは6若しくは(二)3	←1. (3) ^	L :	
若しくは4又は第十六号ロに該当するものを除く。又第6条	(3)	省令第6条	
第十六号の二に該当するものの製造に必要な技術を除く。)		第号()	
(外7項(1)、省令第19条第1項第二号)			
【は いと答えた場合、次の問に回答のこと】			
・次のいずれかの除外規定に該当するか?	□はい	□ いいえ	
□省令第6条第一号ハからルまでのいずれかに該当する	(規制除外される)	(規制除外されない)	
集積回路のうち、次の(一)および(二)に該当するか?	↓	↓	最小線幅
□ (一):最小線幅が0.130マイクロメートル以上のもの	·		(μ m)
□ (二):多層構造を有するもの(金属層が3層以下の			金属層
ものに限る。)			(層)
□ プロセスデザインキット(省令第6条第一号から第八号の			
四までのいずれかに該当する貨物に係る機能又は技術を			(注5)
実装するライブラリが含まれているものを除く。)か?			
(3)マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコント	□いいえ	□はい	ビット数
ローラのコアであって、論理演算ユニットのアクセス幅のビッ	←1. (4) ^		(Ľ"ット)
ト数が32以上のものか?			(注6)
・次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な			
技術か?			
イ:ベクトル演算器であって、浮動小数点ベクトル演算処理を	□いいえ	□はい一	浮動小数点ベクトル演算
同時に2を超えて実現できるように設計したもの			処理数(注7、8)
	·	`	()
ロ:64ビット以上の浮動小数点演算処理を1サイクル当たり	□いいえ	□はい	浮動小数点演算
4を超えて実現できるように設計したもの	1	\ \ \ \ \ \ \ \ \	処理数(注9)
	_		(/サイクル)
ハ:16ビットの固定小数点積和演算処理を1サイクル当たり	□いいえ	□はい	固定小数点積和演算
8を超えて実現できるように設計したもの	←1 . (4) ヘ		処理数(注10、11)
(外7項(3)、省令第19条第3項第三号)			(/サイクル)
【は いと答えた場合、次の問に回答のこと】			
・貨物等省令第19条第3項第三号中の技術において、	□はい	□ いいえ	(注12)
役務通達 7の項(注12)の確認を行う。	(規制除外される)	(規制除外されない)	最小線幅
・確認の結果、「はい」の場合「規制除外される」、	1	↓	(μm)
「いいえ」の場合「規制除外されない」。			金属層
(役務通達 7の項)			(層)
	I	I	

集積回路、真空電子デバイス等電子デバイス、記録装置、 汎用電子計測装置及び半導体製造装置等に係る技術

パラメータシート (エレクトロニクス・技術) 様式:6T-1

(P2/4)

CISTEC 2021. 12. 15

外為令別表の7の項、省令第19条第1項~第5項

今和9年19日15日旅行少今等対応

が荷巾別衣の7の頃、旬巾第19末第1項で第5項			100吨1111111111111111111111111111111111
質問事項	回答	答(注 1)	備考
(4)直径300ミリメートルのシリコンウエハーであって、	□いいえ	□ は い	(注13)
外周の除外領域を2ミリメートル以下としたウエハーの表面	\downarrow	\Box	
に対するスライス、研削及び研磨の技術のうち、長さ26ミリ			
メートル、幅8ミリメートルの長方形に分割されたいずれの			
領域における平坦度が20ナノメートル以下を達成するため			
に必要な技術			
(外7項(3)、省令第19条第3項第五号)			
[省令第19条第3項、第4項及び第5項の技術]			
2. 次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る			
技術(プログラムを除く。)か?			
(1)絶縁体が二酸化けい素からなる集積回路のSOI基板	□いいえ	□ は い	
(シリコンオンインシュレータ構造を有する集積回路の基板)			
(外7項(3)、省令第19条第3項第二号)	Ť		
(2)超電導材料を用いた電子素子	□いいえ	□はい	
(外7項(4)、省令第19条第4項)			
(3)真空マイクロエレクトロニクス装置	□いいえ	□ は い	
(外7項(5)、省令第19条第5項第二号)	$\overline{\downarrow}$		
(4)ヘテロ接合の半導体素子(動作周波数が31.8ギガヘルツ	□いいえ	□ は い	(注14)
未満の高電子移動度トランジスタ又はヘテロ接合バイポー	$\overline{\downarrow}$	<u> </u>	
ラトランジスタを除く。)			
(外7項(5)、省令第19条第5項第三号)			
(5)ダイヤモンドの薄膜又は炭化けい素を用いた電子機器の	□いいえ	□ は い	
部分品として用いる基板	↓	↓	
(外7項(5)、省令第19条第5項第四号)			
(6)動作周波数が31.8ギガヘルツ以上の真空電子デバイス	□いいえ	□ は い	(注15)
(クライストロン、進行波管、これらから派生したものを含む。)			
(外7項(5)、省令第19条第5項第五号)	←【判定】欄へ	←【判定】欄へ	
[省令第19条第1項、第2項、第3項及び第5項のプログラム]			
□ 3. 次のいずれかに該当するプログラムか?	_	_	
(1)省令第6条第十六号ロに該当する原子周波数標準器	□いいえ	<u> はい</u>	「付表技術」(注3)
を設計し、又は製造するために設計したプログラム	↓ ↓	↓	
(外7項(1)、省令第19条第1項第三号)		省令第6条	省令第6条
		第号()	第十六号口は
			「 告示貨物」 (注4)
(a) (b) A th a A th 1 + 1 + 2 = -1 + 1 + 1 + 2 = -1 + 1 + 2 = -1 + 1 + 2 = -1 + 2 =			
(2)省令第6条第十六号の二に該当するスプレー冷却方式の	□ いいえ	<mark>はい</mark>	
熱制御装置を設計するために設計したプログラム (外7項(1)、省令第19条第1項第四号)	↓	↓	
(外/頃(八), 有7第19宋第1項第四方)			
(3)省令第6条に該当するもの(上記(1)及び(2)に該当する	□いいえ	□はい	
もの又は省令第6条第一号若しくは第十八号から第二十		16 0.	
四号までのいずれかに該当するものを除く。)を設計し、又	*	│ ↑ 省令第6条	
は製造するために設計したプログラム		第号()	
(外7項(1)、省令第19条第1項第五号)			
WINNEY TO THE TOTAL STATE OF			
(4)省令第6条第十七号イ、ロ、ホ、ヘ又はヌのいずれ	□いいえ	□ は い	
かに該当するものを使用するために設計したプログラム	$\overline{\downarrow}$	<u></u> —	
(外7項(2)、省令第19条第2項)		省令第6条	
		第号()	
(5)集積回路の設計又は製造に係る技術であって、	□いいえ	□ は い	(注16、17)
極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用の	↓	↓ ↓	
マスク又はレチクルのパターンを設計するために特に			
設計したコンピューテーショナル・リソグラフィ・プログラム			
(外7項(3)、省令第19条第3項第一号)		1	

集積回路、真空電子デバイス等電子デバイス、記録装置、 汎用電子計測装置及び半導体製造装置等に係る技術

パラメータシート (エレクトロニクス・技術) 様式:6T-1

(P3/4)

CISTEC 2021. 12. 15

外為令別表の7の項。省令第19条第1項~第5項

(令和3年12月15日施行省令等対応)

質問事項	回答(注1)		備考
(6)電磁パルス又は静電放電による中断から1ミリ秒以内に 動作の連続性を失うことなくマイクロコンピュータ又は マイクプロセッサを正常状態に回復するように 特に設計したプログラム (外7項(3)、省令第19条第3項第四号)	□ いいえ ←【判定】欄へ	□ <u>は い</u> ←【判定】欄へ	
【判定】以上の結果、省令第19条に該当するか?	□ 非該当	□該当	(注1)
該 当 項 番	① 外為令別表の ② 貨物等省令の 省令第19条 省令第19条 省令第19条 (〕及び	条項等の番号等 第[]項()号(第[]項()号(第[]項()号())) !入する。)

- (注1) 回答欄において、 やで囲まれたものを除き、アンダーラインがついたものが一つでも右欄にチェックされた場合、当該の技術又はプログラムは該当と判定され、左欄のみにチェックされた場合は非該当と判定される。
- (注2) 「省令第19条に掲げる技術(プログラムを除く。)」には、半導体素子又は集積回路の設計のためのライブラリ、設計情報又は関連データを含む。 「省令第19条第3項に掲げる技術」は、省令第19条第1項に掲げる技術及び外為令別表の4の項の中欄に掲げる技術を除く。 「省令第19条第4項及び第5項に掲げる技術」は、省令第19条第1項に掲げる技術を除く。
- (注3) 「付表技術」とは、「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」(輸出注意事項24第18号)の別表2の付表1に該当するものをいう。
- (注4) 「告示貨物」とは、「輸出貿易管理令別表第3の3の規定により経済産業大臣が定める貨物」(平成13年12月28日付け告示第758号)に該当するものをいう。
- (注5) 「プロセスデザインキット」とは、技術的及び製造上の制約に従い、特定の半導体プロセスを使用した、特定の 半導体集積回路の設計に必要とされる設計活動やルールが保証された設計ツールであって、半導体製造者から 提供されるものをいう。
- (注6) 「マイクロプロセッサ」には、マイクロコンピュータを除き、デジタルシグナルプロセッサ、デジタルアレイプロセッサ、デジタルコプロセッサ及び複数のチップから構成されたものであって、一緒に動作することによりマイクロプロセッサ機能を与えるように設計したチップセットを含む。
- (注7) 「ベクトル」とは、32ビット以上の一次元配列をいう。
- (注8) 「ベクトル演算器」とは、浮動小数点ベクトル演算を同時に実行する命令が組み込まれたプロセッサ要素であって、 少なくとも一つのベクトル演算ロジックユニット及び32要素以上のベクトルレジスタを有するものをいう。
- (注9) 「浮動小数点」とは、IEEE-754で定めるものをいう。
- (注10)「固定小数点」とは、整数部と小数部の双方からなる固定幅の実数であって、整数のみの形式を含まない。
- (注11)「16ビットの固定小数点積和演算処理を1サイクル当たり8を超えて実現できるように設計したもの」とは、 音声や画像などのアナログ情報をデジタル的に処理するものをいう。デジタルシグナルプロセッサともいう。
- (注12) 「貨物等省令第19条第3項第三号中の技術(プログラムを除く。)」は、役務通達 7の項により、拡張命令を通じてアナログ信号をデジタル的に処理するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)、又は最小線幅が 0. 13マイクロメートル以上、かつ、金属層が5層以下の多層構造を有するマイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ若しくはマイクロコントローラのコアの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)に該当する技術を除く。
- (注13)「平坦度」とは、最小二乗法により求められた全ての表面データ(領域における境界領域を含む。)について、 基準表面からの最大偏差と最小偏差の範囲をいう。
- (注14)「省令第19条第5項第三号中の半導体素子に掲げる技術(プログラムを除く。)」は、光デバイス(発光ダイオード (LED)、レーザー発振器、フォトダイオード、フォトトランジスタ、フォトカプラ、太陽電池セル、光導波路等)を除く。
- (注15)「真空電子デバイス」とは、真空回路における電磁波の伝搬又は無線周波数空洞共振器を使用した電子ビームの相互作用を基礎とした電子デバイスをいう。
- (注16)「極端紫外」とは、電磁波スペクトルの波長が5ナノメートルを超え、124ナノメートル未満のものをいう。
- (注17)「コンピューテーショナル・リソグラフィ」とは、コンピュータモデルを使用して、様々なパターン、プロセス及びシステム 条件においてリソグラフィプロセスの結像性能を予測、修正、最適化及び検証を行うことをいう。

集積回路、真空電子デバイス等電子デバイス、記録装置、 汎用電子計測装置及び半導体製造装置等に係る技術

パラメータシート (エレクトロニクス・技術) 様式:6T-1

> CISTEC 2021. 12. 15 (令和3年12月15日施行省令等対応)

(参考情報)特別一般包括許可の適用可否判断用チェック欄

(【判定】欄が該当の場合のみ記入。非該当の場合は記入不要。) 回答 備考 質問事項 次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術か? (1)省令第6条第二号に該当するマイクロ波用機器又は □いいえ □はい ミリ波用機器の部分品のうち窒化ガリウム(GaN)を用いた 基板又は窒化ガリウムのエピタキシャル層を有する基板を (注18) 参照 使用したもの (2)省令第6条第十八号、二十二号、二十三号、二十四号 □いいえ □はい に該当する窒化ガリウム(GaN)を用いた基板 (注:エピタキシャル/非エピタキシャル層のみに (注18) 参照 窒化ガリウムを含む基板は対象としない)

(注18)「はい」の場合、特別一般包括許可を適用できる仕向地が限定される。

検討の結果、以上のとおり相違ありません。

(3)省令第6条第十九号に該当するもの

(レジスト又はそれを塗布した基板)

<u> </u>					
作成責任者:(作	成年月日	 年	.月	_日)	
会 社 名					
所属•役職					
(フリガナ)	()	
氏 名				印	
電 話					

□いいえ

□はい

(注18) 参照